

分析技術セミナー SEM・EDX、蛍光X線の基礎

主催 福島県ハイテクプラザ いわき技術支援センター

より良い工業製品を製造するために、製品や不具合品の状況を観察・分析することは重要なプロセスです。数多くある分析装置の中でSEM・EDXは拡大観察や分析、蛍光X線装置は分析や膜厚測定などに広く用いられています。これらの観察・分析を行う上で各装置の特性、観察や前処理のテクニックを熟知することでより正確な結果を得ることが可能となります。今回は、走査型電子顕微鏡（SEM）、SEMの前処理、エネルギー分散型分析装置（EDX）、蛍光X線分析装置についての講習を行います。なお、本講習会は初心者から中級者向けの内容となります。

○日 時 平成29年 9月13日（水）13:00～17:00

○内 容

1. SEMの原理と観察テクニック ～SEMで何ができるのか～
2. 最新SEMご紹介
3. SEM試料前処理の基礎 ～SEM観察のために何が必要か～
4. 最新イオンミリング装置ご紹介
5. EDXの原理と分析の基礎
6. 蛍光X線の原理と分析の基礎 ～メッキ厚の測定～
7. 質疑応答

○講 師 (株)日立ハイテクノロジーズ、アメテック(株)、(株)日立ハイテクサイエンス

○場 所 福島県ハイテクプラザ いわき技術支援センター 研修室
(いわき市常磐下船尾町杭出作23-32)

○定 員 30名

○受 講 料 無料

○締 切 平成29年 9月 6日（水）

○申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailでお申し込みください。

○申込・問合せ先 福島県ハイテクプラザいわき技術支援センター 機械・材料科 担当：橋本
〒972-8312 いわき市常磐下船尾町杭出作23-32

Tel : 0246-44-1475 Fax : 0246-43-6958 E-Mail : iwaki-kizai@pref.fukushima.lg.jp

----- 「分析技術セミナー」 申込書 -----

FAX:0246-43-6958 E-mail:iwaki-kizai@pref.fukushima.lg.jp

企業名（業種）	()
所在地	(〒)
電話/FAX	電話 / FAX
氏名 ふりがな	()
氏名 ふりがな	()

事務連絡担当者 所属

お名前

(受講者と異なる場合はご記入ください)